

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 115021

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)5月8日 □

H 01 H 33/56

H - 6751 - 5G

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全5頁)

図発明の名称 ガス遮断器

> 到特 頤 昭63-237463

願 昭63(1988)9月20日 29出

優先権主張 図1987年9月23日図西ドイツ(DE)図P3732471.3

ドイツ連邦共和国ベルリン27、ヌスヘーハーシュトラーセ 70発明者 ヘルムート、パイエル

母 明 者 ウオルフガング、クヌ ドイツ連邦共和国ベルリン28 クナイプシュトラーセ14

シーメンス、アクチエ 包出 願 人

ドイツ連邦共和国ベルリン及ミユンヘン(番地なし)

ンゲゼルシヤフト

20代 理 人 弁理士 富村 潔

- 1. 発明の名称 ガス遮断器
- 2.特許請求の範囲
 - 1) 基準容積を有し外部に置かれた少なくとも 一つのガス密度モニタを備え、このモニタが 遮断器の閉鎖されたガス室に結合され、かつ 制御箱の中に収容された保護装置又は表示装 置に通じる電気接点を有するようになって いるガス遮断器において、ガス密度モニタ (6)がそれぞれ電気接点(8)のために 一側を開放された接続室(9)を有しかつ接 統プロック(16)に結合され、接続プロッ クには遮断器のガス室に結合するための管盤 手(17)と保守又は充填のための管離手 (28)とが設けられ、接続室(9)は制御 箱(4)の壁(7)の孔(10)の中へ制御 箱の中に向かって開放されて突入し、孔の縁 (11) は接続室(9)の僻壁を間隙を置い て囲み、かつ弾性材料から成るリップパッキ ン(12)を支持し、このリップパッキンが

制御箱(4)の壁(7)の孔(10)の縁を **投いかつこの壁に取り付けられ、接続ブロッ** ク(16)には弓形支持体(29、30)が 設けられ、これらの支持体がリップパッキン (12) に結合されることなく制御箱 (4) の壁(7)に取り付けられていることを特徴 とするガス遮断器。

- 2) 遮断器のガス室に通じる管離手(17)の 中に逆止弁(19)が設けられ、この逆止弁 が管難手(17)を接続プロック(16)か ら取り外した際に自動的に閉じることを特徴 とする請求項1記載のガス遮断器。
- 3) ガス室に通じる管離手 (17) が接続プ ロック(16)に対して差し込みパッキン (26)を備えることを特徴とする請求項2 記載のガス遮断器。
- 4) 胡御箱(4)の壁に取り付けられたリップ パッキン(12)の周録がカバー板(15) により覆われ、このカバー板が固定手段 (14)により貫かれていることを特徴とす

る請求項 1 ない し 3 の一つに記載のガス遮断器。

- 5) 接続室(9)が円筒形に形成され、四角形のリップパッキン(12)の中央の円形の孔(13)を貫くことを特徴とする請求項1 又は4記載のガス臨断器。
- 8) リップパッキン(12)がゴムから成ることを特徴とする請求項1又は4又は5の一つに記載のガス遮断器。
- 7) 第1の弓形支持体(29)が接続プロック (16)の上側に取り付けられ、第2の弓形 支持体(30)が第1の弓形支持体に対し 90°ずらして配置されていることを特徴と する請求項1記載のガス遮断器。
- 8) ガス密度モニタが複数の場合に第3の弓形 支持体が接続プロック(18)に取り付けられることを特徴とする請求項1又は7記載の ガス遮断器。
- 8) 弓形支持体がつぼ状に形成され通気孔を備えていることを特徴とする請求項1配載のガ

自動的に補正され、また場合によっては複数のガス密度モニタを使用することにより監視系の誤差が自動的に補正される。基準容積を有するガス密度モニタは、遮断器と同じ周囲温度を持つために外気中に置かれるように配置しなければならない。その際保護装置又は表示装置に結合された電気接点が容易に汚れ又は結構するおそれがあるという問題が生じる。

[発明が解決しようとする課題]

この発明は、ガス遮断器で使用され基準容積を 有するガス密度モニタの作動能力と監視能力とを で改善することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

この目的は前配の種類のガス遮断器においてこの角明に基づき、ガス密度モニタがそれぞれ電気接点のために一個を開放された接続室を有しかつ接続プロックに結合され、接続プロックには遮断器のガス室に結合するための管離手と保守又は開発の虚のれの中へ制御箱の中に向かって開放されて

ス遮断器。

3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明はガス遮断器、特に高電圧SF。ガス 遮断器に関する。

[従来の技術]

基準容積を有し外部に置かれた少なくとも一つのガス密度モニタを備え、このモニタが遮断器の閉鎖されたガス室に結合され、かつ制御箔の中に収容された保護装置又は表示装置に通じる電気接点を有するようになっているガス遮断器が知られている。

ガス密度モニタのかかる使用は一般に行われ、 特にドイツ連邦共和国特許第2529733 号明細書から知られている。基準容積を有するガス密度モニタは遮断器の消弧装置又は絶縁装置の中のガス密度を監視し、ガスの密度が確実な遮断に対してもはや十分でないときに警報個号又は鎖錠を作動させる。ガス密度モニタによる自動的な監視の際に基準容積により環境条件特に圧力と温度との変化が

突入し、孔の縁は接続室の側壁を間隙を置いて囲み、かつ弾性材料から成るリップパッキンを支持し、このリップパッキンが制御箱の壁の孔の縁を覆いかつこの壁に取り付けられ、接続プロックには弓形支持体が設けられ、これらの支持体がリップパッキンに結合されることなく制御箱の壁に取り付けられていることにより達成される。

[作用効果]

電気接点のための一個を開放された接続室が制御箱の中に導入され、一方ガス密度モニタ自体は外気温度が直接作用する外部空間に留まってと外気温度が直接作用する外部空間に留まってといいる。これに反して電気接点は一般に吸して置めれて吸いる。それに反り結構又は汚過を生するおそれにより結構の整との直接の固定によがない。接続室と制御箱の整との直接の関係に入れるが回避されているゆえに、開閉動作のの原に発生するおそれのある振動又は制御箱上に作用で、がス密度モニタはその機能について影響を受けない。

更に遮断器のガス室に結合するための管難手と 充填及び保守のための管離手とを備えガス密度モニタの運転のために必要な比較的重い部分は接続 ブロックにまとめられ、この接続ブロックはリッ ブパッキンとは結合されず分離して制御箱の強に 直接取り付けられ壁により支持されている。

選断器のガス室に通じる管離手の中に逆止弁を設けるのが有利であり、逆止弁は管離手を接続プロックから取り外した際に自動的に閉じる。 それにより管離手を接続プロックから取り外さるいけるではなったが選挙を開発したが変に、ガスが遮断器のガス室から逸げるとが防止される。こので数では進むを問題無くが明じ終るまでに必要な僅かな道程を問題無くがであるために、接続プロックに対する差し込みパッキンをこの管離手に設けることが更に合目的である。

接続プロックの弓形支持体の配置又は形状は、 日照によるガス密度モニタの過度の温度上昇が避 けられるように選択すべきである。このために

めに必要なモジュールと、 制御導線のための接続 端子と共に測定装置とが収容されている。 制御箱 4の内部は暖めることができる。

ガス密度モニタ 6 の電気接点 8 は一側を開放された円筒形の接続室 9 の中に置かれている。接続室は制御箱 4 の側壁 7 の孔 1 0 を賃通し、孔の縁1 1 は接続室 9 を削除を保って囲む。この孔 1 0

二つの弓形支持体を990° ずらして配置すること ができ、これらの弓形支持体のうちの一つの 支持体 がっかったの 上側に取り付けられる。 しつ が 形成 し 通気 孔を設け か し 合目的 で あろう。 そのとき ガス 密度 モニタは は の の で 直接 の 日 無 が 的 ら さ れ に ま ま で ある。 それに よ り 異なる 材料 か ら 成る 個々の 部 品 の 温度 上昇の 異なる 認要示が 防止される。

〔 実 施 例 〕

次にこの発明に基づくガス遮断器の一実施例を 示す図面により、この発明を詳細に説明する。

を閉鎖するために、接続室9はゴムから成り弾性を有するリップパッキン12を支持する。このために接続室9はリップパッキン12の円形の中央の孔13に貫揮され、リップパッキンは接続室9の挿入の際に広がらなければならないような寸法に選ばれ、その弾性によりしっかりとかつ封止して接続室9の外壁に接触する。

ガス密度モニタ6は制御箱4の外側に置かれた。 従って周囲の外気にさらされている。ガス密度 こタ6は更に遮断器の支持がいし2とこれ である。 なの中の監視すべたがしてはいれたでは がの中のない。その情報手17が設けられてのない。 がはプロック16に管轄手17が設けられてのに がはプロック18に管轄チ17な統プロック16に が設けられていたで管 はずけけられては逆止焼けったのは なりのの協面21は接続である。それには でののは でのの。 でののは でののは でののは でのので でのので でのので でのので でのので でのので でのので でのので でのので でので でのでので でので でので でので でので でので でのでで でのでで でのでで でのでで でのでで でのでので でのでで でのでで でので でのでので でので でのでで でのでで でのでで でので

管離手17のフランジ18の中央部分にはリング状付加部25が設けられ、この付加部は凹所23に係合しかつ弁棒20により貫通されている。凹所23の円筒面に向かう付加部の外側円筒面上に、このリング状付加部25は差し込みパッキン26を支持する。ガス密度モニタ6の保守又は交換のために遮断器のガス室に結合された管

らして配置され、従って第2の弓形支持体はガス 密度モニタ 6 と接続プロック 1 6 との前側を覆い、同様に日照に対して保護する。それにもかか わらず周囲の外気はガス密度モニタ 6 に容易に到 達する。 遮断器の据え付け方向が異なる場合に は、第2の弓形支持体 3 0 をガス密度モニタ 6 の 後ろに置くこともできる。

複数のガス密度モニタ6が制御箱4に上下に並べて機向きに固定されているときには、相応に一層大きく形成された接続プロック16の重量を支持できるまで弓形支持体30を大きくすることが推奨されるが、また別の第3の弓形支持体を設けることもできる。

4 、図面の簡単な説明

第1図はこの発明に基づくガス遮断器の一実施例の正面図、第2図及び第3図はそれぞれ第1図に示すガス監視ユニットの部分的断面を含む側面図及び背面図である。

4 … 朗賀箱

6 … ガス密度モニタ

制御箱4の側壁7での接続プロック16の分離された取り付けのために、リップパッキン12の固定部の外側で側壁7にねじ止めされた固有の弓形支持体29、30が用いられる。両弓形支持体29は接続プロック16とガス密度モニタ6との上側に横にして配置され、これらを同時に耐又は日照の作用に対し並びに落下物に対し保護するようになっている。第2の弓形支持体30は前記の弓形支持体に対して90°ず

7 … 駐

8 … 電気接点

9…按統室

10…孔

1 1 … 録

12…リップパッキン

13…羽

1 4 … 固定ポルト

15…カバー板

16…接続プロック

17、28…管難手

19…逆止弁

26… 差し込みパッキン

29、30… 弓形支持体

(6118) 代理人 弁理士 富村





